

بررسی خواص فتوکاتالیستی لایه‌های NiO/TiO_2 رشد داده شده به روش اکسیداسیون پلاسمای الکتروولیتی / رسوب الکتروفورتیک

سمیرا بساکی^{۱*}، فرهاد گلستانی فرد^۱، رحیم نقی‌زاده^۱ و مهدی رشید‌زاده^۲

۱- دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

۲- پژوهشکده کاتالیست، پژوهشگاه صنعت نفت

(دریافت مقاله: ۱۳۹۳/۰۳/۱۹ - دریافت نسخه نهایی: ۱۳۹۳/۰۹/۱۷)

چکیده - در این پژوهش اکس کامپوز مخلخل اکس رسوب الکتروفورتیک (PEO/EPD) ایجاد شد. هدف اصلی این پژوهش، افزایش فتوکاتالیز اکس با استفاده از سطح و ظه بالا و جفت کردن آن با اکس کل است. در لتأثر اعمال اند بر ساختار فازی دمورفلوژی و توان فتوکاتالیز مطالعه و بررسی شد. ساختار فازی و ریز ماده - کلروفنل روی این اکس با استفاده از XRD و SEM بررسی شد. قدرت فتوکاتالیز اکس با اندازه یابی از فاز آناناز و هم ن اکس کل تشکیل شده‌اند که با افزایش و لتأثر این فازها در پوشش افزایش می‌یابند. این اکس کامپوز NiO/TiO_2 توان فتوکاتالیز ای از پوشش اکس کل در تجزیه ماده مدل - کلروفنل از خود نشان دادند. نتیجه نشان داد که کمترین مقدار به نه اکس کل برای حصول به نه توان فتوکاتالیز اکس وجود دارد.

واژگان کلیدی: NiO/TiO_2 روش PEO/EPD، فعالیت فتوکاتالیستی

Investigation of Photocatalytic Properties of NiO/TiO_2 Layers Grown via PEO/EPD Method

S. Bassaki^{1*}, F. Golestani Fard¹, R. Naghizadeh¹ and M. Rashidzadeh²

1- Department of Materials Science and Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

2- Catalysis Research Center, Research Institute of Petroleum Industry, Tehran, Iran

* مسئول مکاتبات، پست الکترونیکی: samira.bassaki@gmail.com

Abstract: Titanium dioxide-nickel oxide porous coatings were synthesized by Plasma Electrolytic Oxidation (PEO)/ElectroPhoretic Deposition (EPD) in one step and within a short time. The main purpose of this research was to increase photocatalytic activity of titanium oxide by increasing surface area and coupling of titanium oxide with nickel oxide. Applied voltage effects on phase structure, surface morphology and photocatalytic efficiency of coatings were studied. Phase structure and surface morphology of the synthesized catalysts were investigated by XRD and SEM, respectively. Photocatalytic efficiency of the samples was studied through measuring the decomposition rate of 4-chlorophenol. The results showed that the coatings mainly consisted of anatase and nickel oxide phases whose amounts in coatings increased with the voltage. There was an enhancement of the photocatalytic efficiency in TiO_2/NiO composite coatings compared with TiO_2 coatings. Besides, there was an optimum amount of NiO to reach maximum photocatalytic efficiently.

Keywords: TiO_2/NiO coatings; Plasma Electrolytic Oxidation/Electrophoretic Deposition (PEO/EPD) method; photocatalytic activity

۱- مقدمه

نوع n (مانند TiO_2) تماس پیدا می‌کند، اتصال $p-n$ در فصل مشترک ایجاد می‌شود. حامل‌های الکترون و حفره به ترتیب به نیمه‌هادی نوع p و n نفوذ می‌کنند و میدان الکتریکی داخلی ایجاد شده در فصل مشترک، به عنوان سد پتانسیل عمل می‌کند. الکترون و حفرات ایجاد شده تحت میدان الکتریکی داخلی از هم جدا می‌شوند. درنتیجه الکترون‌ها و حفرات به طور مؤثری از هم جدا شده، فعالیت فتوکاتالیستی درنتیجه کاهش سرعت بازترکیب، افزایش می‌یابد [۲، ۴، ۱۶، ۱۷].

فیلم اکسید تیتانیم به وسیله روش‌های مختلفی از قبیل سل‌ژل [۱۸]، رسوب شیمیایی از فاز بخار [۱۹]، رسوب فیزیکی از فاز بخار [۲۰]، فرایند هیدروترمال [۲۱]، رسوب از فاز مایع [۲۲] و روش‌های الکتروشیمیایی مانند رسوب الکتروفورتیک [۲۳] ساخته شده است. رسوب الکتروفورتیک (EPD^۱، یک روش پوشش‌دهی کلوئیدی است که در آن، ذرات پودری در یک حلال پراکنده می‌شوند و در آن یک بار سطحی مشخصی را به دست می‌آورند. تحت تاثیر میدان الکتریکی اعمالی، این ذرات به سمت الکترود با بار مخالف (به عنوان زیرلایه) حرکت می‌کنند و در آنجا رسوب می‌کنند. رسوب الکتروفورتیک یک روش ساده و اقتصادی برای ساخت گستره وسیعی از پوشش‌ها با ریخت (مورفولوژی) و ترکیب شیمیایی متنوع است [۲۴، ۲۵].

اکسید تیتانیم هم‌چنین می‌تواند بوسیله فرایند اکسیداسیون پلاسمای الکترولیتی (PEO^۲) ساخته شود. اکسیداسیون پلاسمای الکترولیتی، یک روش الکتروشیمیایی برای رشد

اکسید تیتانیم (TiO_2) یک نیمه‌هادی اکسیدی نوع n است. این نیمه‌هادی به دلیل خواص نوری و الکترونی خوب، قابلیت اکسیداسیون بالا، قیمت به نسبت پایین، غیر سمی بودن و پایداری حرارتی و شیمیایی بالایش، کاربردی‌ترین فتوکاتالیست محاسب می‌شود که می‌تواند در گستره وسیعی از کاربردهای فتوکاتالیستی به کار رود. فعالیت فتوکاتالیستی اکسیدتیتانیم تا حد زیادی به خواص سطحی و ساختاری مانند ساختار فازی، اندازه کریستالیت‌ها، شکاف انرژی، سطح ویژه و تخلخل‌های آن وابسته است [۱، ۲]. شکاف انرژی نسبتاً وسیع اکسیدتیتانیم (۳/۲ الکtron-ولت برای آناتاز) و هم‌چنین بازترکیب سریع جفت الکترون - حفره‌های ایجاد شده با نور، بازده فرایند فتوکاتالیستی را کاهش می‌دهد [۳، ۴]. بهبود فعالیت فتوکاتالیستی اکسیدتیتانیم یکی از موضوعات جذاب برای پژوهشگران در سال‌های اخیر بوده است. یکی از روش‌های ممکن به منظور افزایش فعالیت فتوکاتالیستی اکسیدتیتانیم، آلایش اکسیدتیتانیم با فلزات یا نافلزات از قبیل [۵] Fe، [۶] Ag، [۷] Mo، [۸] V، [۹] Ni، [۱۰] N و [۱۱] S است. روش دیگر، ایجاد فتوکاتالیست‌های کوپل شده در راستای کاهش بازترکیب الکترون - حفره‌های ایجاد شده با نور است. تاکنون اکسیدتیتانیم با نیمه‌هادی‌های مختلفی از قبیل [۱۲] CdS، [۱۳] MoO₃، [۱۴] Fe₂O₃ و [۱۵] NiO جفت شده است. وقتی یک نیمه‌هادی نوع p (مانند NiO) با یک نیمه‌هادی

بهره‌مندی از سطح ویژه بالا و تأثیر جفت کردن نیمه‌هادی‌ها در راستای بهبود فعالیت فوتوكاتالیستی اکسیدتیانیم است.

۲- روش پژوهش

۲-۱- آماده‌سازی کاتالیست‌ها

در این پژوهش از زیرلایه‌های تیتانیمی خالص تجاری گردید ۲ (ابعاد $5 \times 15 \times 30$ میلی‌مترمکعب) به عنوان زیرلایه استفاده شد. به‌منظور آماده‌سازی سطح زیرلایه‌های مصرفی، فرایند تمیزکاری در چهار مرحله و به‌شرح زیر انجام گرفت:

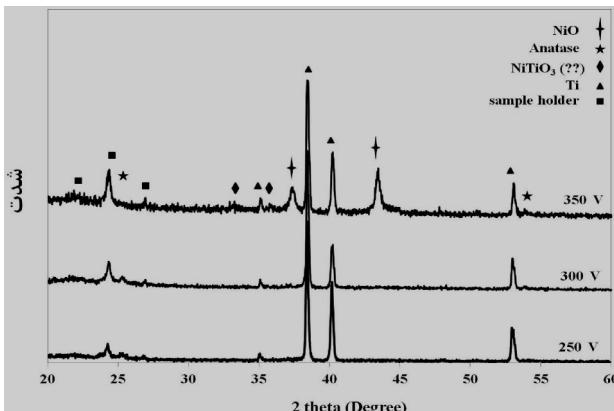
ابتدا سطح ورق‌های تیتانیمی با استفاده از کاغذ سنباده شماره ۶۰۰ تحت جریان آب ساییده شد. سپس عملیات قلیاشویی با روش غوطه‌وری (محلول ۶۰ درصد هیدروکسید سدیم و دمای ۵۰ درجه سانتی‌گراد) به مدت ۳۰ دقیقه انجام گرفت. سپس زیرلایه‌ها به مدت ۳۰ ثانیه تحت عملیات حکاکی شیمیایی (محلول ۵ درصد اسیدفلوریدریک) قرار گرفتند. درنهایت نمونه‌ها به مدت ۱۵ دقیقه در محلول استون و با استفاده از دستگاه اولتراسونیک، تمیزکاری شدند. لازم به ذکر است که بین مراحل یاد شده، زیرلایه‌ها با آب مقطر شسته می‌شدند. زیرلایه با یک کاتد استوانه‌ای از جنس فولادزنگ نزن نوع ۳۱۶ احاطه شد که به قطب منفی دستگاه متصل می‌شد تا یک میدان الکتریکی یکنواخت بین آند و کاتد فراهم شود.

الکترولیت، محلول آبی حاوی نمک فسفات سدیم (Na₃PO₄.12H₂O, Panreac) با غلظت ۱۰ گرم در لیتر و ۵ گرم در لیتر ذرات اکسید نیکل در سایز میکرون (Merck) بود. الکترولیت تهیه شده، توسط هم‌زن مغناطیسی (با سرعت ۶۰۰ دور در دقیقه) به مدت ۴ ساعت و اولتراسونیک به مدت یک ساعت در دمای محیط هم‌زده شد تا سوسپانسیون یکنواخت و پایداری حاصل شود. pH الکترولیت با استفاده از نمک فسفات سدیم مورد استفاده، روی ۱۲ تنظیم شد. هدف از رسیدن به چنین pH بالایی، القای بار الکتریکی سطحی منفی به ذرات اکسید نیکل مصرفی در الکترولیت بود تا حرکت آن‌ها به سمت آند تسهیل شود. دمای الکترولیت با استفاده از یک

فیلم‌های اکسیدی متخلخل بر روی فلزاتی مثل تیتانیم، آلومینیم، منیزیم، زیرکنیم و آلیاژهای آن‌هاست. این فرایند در ولتاژ‌های بالاتر از ولتاژ شکست لایه گازی پوشاننده اطراف آند انجام می‌شود. تحملیه‌های الکتریکی عامل حفرات ساختاری هستند. از مزایای این روش، امکان کنترل شیمی و ریزساختار سطح با استفاده از کنترل شرایط فرایند است. سرعت تولید بالا، سختی بالا، مقاومت به سایش و چسبندگی عالی به زیر لایه از دیگر مشخصات این فرایند است [۲۶-۲۹].

کو و همکارانش [۱۵] فوتوكاتالیست‌های NiO/TiO₂ مزومتخخلل را با استفاده از روش سل ژل تهیه کردند و نشان دادند که فعالیت فوتوكاتالیستی بالاتری را برای احیای کروم ظرفیت شش (Cr(VI)) در محلول آبی از خود نشان می‌دهند. شیفو و همکارانش [۱۶] نیز فوتوكاتالیست‌های NiO/TiO₂ را به روش سل ژل تهیه کردند و توان فوتوكاتالیستی این نمونه‌ها را در احیای Cr₂O₇⁻² مورد بررسی قرار دادند و مشاهده کردند که توان فوتوكاتالیستی بسیار بالاتری نسبت به TiO₂ از خود نشان می‌دهند. چن و همکارانش [۳] فوتوكاتالیست‌های کامپوزیتی NiO/TiO₂ را به روش تلقیح (آگوشه سازی) مرتبط تهییه کردند و نشان دادند که NiO/TiO₂ ۰/۵%wt دارای بالاترین فعالیت فوتوكاتالیستی در مقایسه با TiO₂ است. آن‌ها اظهار داشتند که فوتوكاتالیست‌های اتصال P-N به‌دلیل ممانعت از بازترکیب الکترون-حرفه، فعالیت فوتوكاتالیستی بالاتری را از خود نشان می‌دهند.

در این مطالعه، برای اولین بار از فرایندهای اکسیداسیون پلاسمای الکترولیتی (PEO) و رسوب الکتروفورتیک (EPD) به‌طور هم‌زمان برای رشد لایه‌های متخلخل NiO/TiO₂ بر روی زیرلایه تیتانیمی طی یک مرحله و زمان کوتاه استفاده شد. در ساخت لایه‌ها به این روش، نیازی به فرایندهای تکمیلی بعدی نیست. تأثیر ولتاژ در غلظت الکترولیت و زمان پوشش‌دهی ثابت بر ترکیب فازی، ریخت سطحی و خواص فوتوكاتالیستی لایه‌های ساخته شده مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش، هدف از ساخت پوشش‌های متخلخل NiO/TiO₂



شکل ۱- طیف‌های پراش اشعه ایکس لایه‌های رشد داده شده در مدت زمان ۵ دقیقه در الکتروولیت با غلظت ثابت (۱۰ گرم در لیتر فسفات سدیم و ۵ گرم در لیتر اکسیدنیکل) و ولتاژ‌های مختلف

(سانتی‌متر)، c غلظت گونه جاذب در ماده (مول در لیتر) و ضریب جذب مولی ماده جاذب (لیتر/سانتی‌متر. مول) هستند.

۳- نتایج و بحث

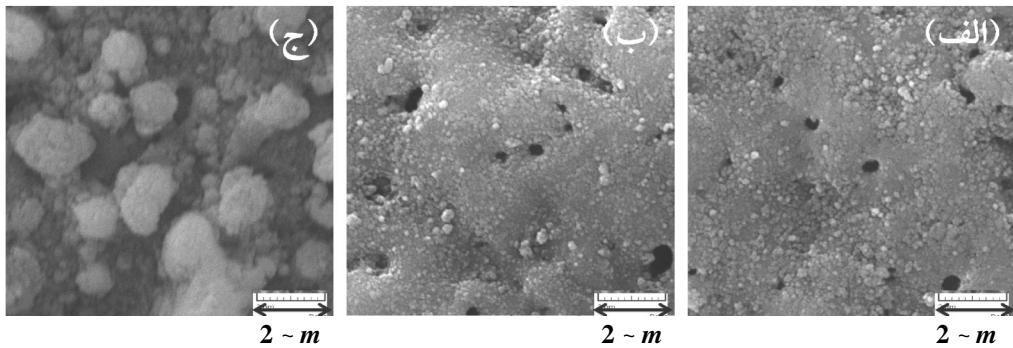
۳-۱- مطالعه ساختار فازی

نتایج الگوی پراش اشعه ایکس برای نمونه‌های تهیه شده در الکتروولیت با غلظت‌های ۱۰ گرم در لیتر فسفات سدیم و ۵ گرم در لیتر اکسیدنیکل و ولتاژ‌های مختلف در شکل ۱ آورده شده است. در ولتاژ‌های پایین ضخامت لایه اکسیدی تشکیل شده روی سطح زیرلایه تیتانیمی کم است. در شرایط ثابت با افزایش ولتاژ اعمالی به سل، جریان عبوری از مدار افزایش می‌یابد. بنابراین با افزایش جریان الکتریکی عبوری از مدار، تعداد الکترون‌های بیشتری به آند می‌رسد و در نتیجه واکنش‌های آندی زیرلایه تیتانیمی تسریع می‌شود که منجر به افزایش لایه اکسیدی روی سطح می‌شود. در نتیجه با افزایش ولتاژ، شدت پیک مربوط به فاز آناتاز افزایش می‌یابد. پیک‌های مربوط به زیرلایه تیتانیمی در الگوی پراش اشعه ایکس این نمونه‌ها دیده می‌شود. وجود پیک‌های مربوط به زیرلایه تیتانیمی به دلیل ضخامت کم و متخلخل بودن پوشش‌های ایجاد شده و عمق

سیستم گردش آب در 70 ± 3 درجه سانتی‌گراد ثابت نگه داشته شد. فرایند پوشش‌دهی در سوسپنسیون آماده شده تحت ولتاژ‌های مختلف (جریان مستقیم) و زمان رشد ۵ دقیقه انجام شد. ریخت سطحی لایه‌های رشد داده شده با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (TESCAN,VegaII) مورد بررسی قرار گرفت. از دستگاه پراش‌سنجدی اشعه ایکس (Philips, PW3710) تحت تابش ($\lambda = 1.54178\text{\AA}$) Cu K (Philips, PW3710) مطالعه ساختار فازی لایه‌های رشد داده شده استفاده شد.

۲-۲- فعالیت فوتوكاتالیستی

خواص فوتوكاتالیستی لایه‌های ساخته شده با استفاده از اندازه‌گیری سرعت تجزیه محلول آبی ۴-کلروفنل (4CP) در دمای محیط بررسی شد. برای انجام تست فوتوكاتالیستی، ۵۰ میلی‌لیتر از محلول ۴-کلروفنل (غلظت 2×10^{-4} مولار) درون بشر ریخته شد. نمونه ساخته شده در ابعاد $1 \times 1 \times 1$ سانتی‌مترمربع برش خورد و درون آن غوطه‌ور شد. در طول آزمایش نمونه‌ها در معرض تابش امواج فرابنفش قرار داده شد تا زوج‌های الکترون- حفره ایجاد شوند. برای تأمین امواج فرابنفش از یک لامپ فرابنفش ۲۵ واتی (طول موج ۳۶۵ نانومتر) استفاده شد. فاصله بین لامپ و ظرف آزمایش در همه آزمایش‌ها برابر ۱۵ سانتی‌متر در نظر گرفته شد. در هر آزمایش قبل از تابش فرابنفش، نمونه غوطه‌ور در محلول به منظور جذب کامل ۴-کلروفنل بر روی سطح نمونه، به مدت ۳۰ دقیقه در محیطی کاملاً تاریک قرار داده می‌شد تا تعادل جذب/ واجذب برقرار شود. سپس محلول تحت تابش فرابنفش قرار گرفت. با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر UV-Vis (مدل Hitachi U3010) و بر اساس قانون بیر- لامبرت، تغییر در غلظت ماده مدل (۴-کلروفنل) اندازه‌گیری شد. هر ۲۰ دقیقه مقدار ثابتی از این محلول در یک سل کوارتزی ریخته شد و جذب آن در طول موج ۲۳۰ نانومتر اندازه‌گیری و سپس غلظت ماده مدل بر اساس رابطه $A = b \times c \times A$ محساسبه شد. در این رابطه A میزان جذب نور در نمونه (بدون بعد)، b طول مسیر



شکل ۲- تصاویر میکروسکوپی الکترونی از لایه‌های رشد داده شده در مدت زمان ۵ دقیقه در الکتروولیت با غلظت ثابت (۱۰ گرم در لیتر فسفات سدیم و ۵ گرم در لیتر اکسیدنیکل) و ولتاژهای (الف) ۳۰۰، (ب) ۲۵۰ و (ج) ۳۵۰ ولت

داده شده در الکتروولیت حاوی ذرات اکسیدنیکل با غلظت ۵ گرم در لیتر و ولتاژ اعمالی مختلف و زمان رشد ۵ دقیقه در شکل ۲ نشان داده شده است. ولتاژ ۲۵۰ ولت برابر یا بیشتر از ولتاژ جرقه زنی لایه اکسیدی و گازی است و از این رو پوشش رشد داده شده متخلخل است. این جرقه‌های موضعی در موضعی از پوشش که مقاومت الکتریکی لایه‌گازی و لایه اکسیدی ایجاد شده روی سطح ضعیف باشد، تشکیل می‌شوند. با افزایش ولتاژ از ۲۵۰ تا ۳۵۰ ولت، مشاهده می‌شود که اندازه حفرات موجود در پوشش افزایش می‌یابد. تخلیه‌های الکتریکی عامل ایجاد حفرات ساختاری اند. با افزایش ولتاژ اعمالی، جریان عبوری از مدار افزایش می‌یابد که منجر به ایجاد جرقه‌های قوی‌تر بر روی سطح آند و درنتیجه ایجاد حفرات درشت‌تر می‌شود. هم‌چنین مشاهده می‌شود که با افزایش ولتاژ اعمالی، مقدار ذرات اکسید نیکل رسوب کرده روی سطح افزایش می‌یابد. همان‌طور که پیش‌تر نیز بیان شد، سطح ذرات داخل الکتروولیت، به مقدار جزئی دارای بار منفی است. پورهای اکسیدی پراکنده شده در الکتروولیت به دلیل وجود میدان الکتریکی بین آند و کاتد، به سمت الکتروود با بار مخالف (آند) منتقل می‌شوند که در آن جا در نهایت با استفاده از فرایند PEO رسوب می‌کنند. با افزایش ولتاژ اعمالی و در نتیجه افزایش رسوب در الکتروولیت وارد می‌شود و منجر به افزایش درصد ذرات اکسیدی رسوب کرده روی سطح می‌شود.

نفوذ بالای اشعه ایکس و نفوذ آن به زیرلایه است. مشاهده می‌شود که در ولتاژهای پایین پیک مربوط به اکسید نیکل مشاهده نشد. این امر می‌تواند به دلیل کم بودن درصد ذرات اکسید نیکل رسوب کرده در پوشش و هم‌چنین ضخامت کم پوشش باشد که منجر به محدودیت XRD در شناسایی فازی آن می‌شود.

با افزایش بیش‌تر ولتاژ، در ولتاژ ۳۵۰ ولت، پیک مربوط به اکسید نیکل مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده مشارکت بیشتر ذرات اکسیدنیکل در ساخت پوشش می‌باشد که مقدار آن قابل شناسایی توسط XRD شده است. در واقع با افزایش ولتاژ اعمالی، مقدار ذراتی که روی سطح پوشش رسوب می‌کنند افزایش می‌یابند. ذرات اکسیدی موجود در الکتروولیت به دلیل pH بالای الکتروولیت ($pH = 12$) دارای بار سطحی منفی هستند [۳۰]. ولتاژ اعمالی نیروی محركه انتقال ذرات به سمت آند است. با افزایش ولتاژ، نیروی محركه بیش‌تری به ذرات Ni موجود در الکتروولیت وارد می‌شود. از طرفی جرقه‌های قوی‌تر حاصله در ولتاژهای بالاتر توانایی بیش‌تری برای حمل و حبس کردن ذرات موجود در الکتروولیت به داخل پوشش را خواهد داشت. لذا تعداد ذراتی که به سمت آند کشیده و در پوشش حبس می‌شوند، افزایش می‌یابد.

۲-۳- بررسی ریخت سطحی تصاویر میکروسکوپی الکترونی (SEM) از پوشش‌های رشد

بسیار پایین تر از آزمایش های انجام شده به همراه کاتالیست بوده است. از آن جا که این مواد آلی معمولاً تحت تابش فرابینفس کمی تجزیه می شوند، محلول ۴-کلروفنل به مدت ۱۸۰ دقیقه تحت تابش فرابینفس قرار گرفت تا مقدار تجزیه آن بدون حضور کاتالیست بررسی شود. این مقدار اندک کاهش غلظت در آزمایش های بدون حضور کاتالیست، به تجزیه مولکول های ۴-کلروفنل در اثر تابش امواج فرابینفس مربوط می شود. بنابراین تخریب ۴-کلروفنل در حضور کاتالیست و تابش امواج فرابینفس عمدتاً به تخریب فوتوكاتالیستی آن توسط لایه های رشد داده شده، نسبت داده می شود.

همان طور که از نتایج مشخص است پوشش ساخته شده در ولتاژ ۲۵۰ ولت فعالیت فوتوكاتالیستی بالایی از خود نشان داده است (حدود ۹۰ درصد تخریب ماده مدل در مدت زمان تابش)، اما با افزایش ولتاژ اعمالی، توان فوتوكاتالیستی لایه ها کاهش یافته است. همان طور که از ریخت این پوشش ها مشخص است (شکل ۲)، در ولتاژ ۲۵۰ ولت مقدار قابل توجهی از ذرات اکسید نیکل روی پوشش رسوب کرده است. ذرات رسوب کرده روی سطح پوشش، در تصاویر مشخص هستند. با افزایش ولتاژ اعمالی، مقدار این ذرات به مقدار زیادی افزایش یافته است به طوری که در ولتاژ ۳۵۰ ولت این ذرات به صورت کلوخه ای روی سطح قرار گرفته اند و سطح اکسید تیتانیم را به کلی پوشانده اند (ظهور پیک بلند و تیز اکسید نیکل در الگوی XRD پوشش ساخته شده در ۳۵۰ ولت). چنین حدس زده می شود که عمدتاً پوشانندگی اکسید تیتانیم توسط ذرات اکسید نیکل رسوب کرده روی سطح منجر به کاهش فعالیت فوتوكاتالیستی شده است. لازم به ذکر است که در پوشش ساخته شده در ۳۵۰ ولت، سطح مؤثر پوشش نیز به دلیل کلوخه ای شدن ذرات اکسید نیکل رسوب کرده و کاهش مقدار تخلخل ها، کم شده است که می تواند به نوبه خود منجر به کاهش فعالیت فوتوكاتالیستی شود.

برای مقایسه فعالیت فوتوكاتالیستی لایه های کامپوزیتی ساخته شده با لایه اکسید تیتانیم خالص، پوشش اکسید تیتانیم در

هم چنین در ولتاژ های بالاتر (۳۵۰ ولت)، تمایل به کلوخه ای شدن ذرات روی سطح مشاهده می شود. دو احتمال برای علت این پدیده وجود دارد. اول این که با افزایش ولتاژ اعمالی، تعداد ذرات بیشتری قوی تری در پوشش قرار می گیرند. افزایش ولتاژ، جرقه های قوی تری در پوشش ایجاد می کند که سبب افزایش دمای آند می شود که می تواند به تفجوشی ذرات مجاور هم رسوب کرده روی سطح پوشش کمک کند. بنابراین این ذرات مجاور هم در اثر دمای بالای ناشی از تخلیه های الکتریکی قوی، در اثر تفجوشی و به هم پیوستن، به صورت کلوخه ای روی سطح نمایان می شوند. احتمال دوم این است که ذرات از ابتدا به صورت کلوخه شده در الکتروولیت حضور دارند و در اثر ولتاژ اعمالی بالاتر که نیروی محرکه بیشتری را به سطح ذرات موجود در الکتروولیت وارد می کند، ذرات بزرگ تر نیز به سمت آند کشیده می شوند و روی سطح رسوب می کنند.

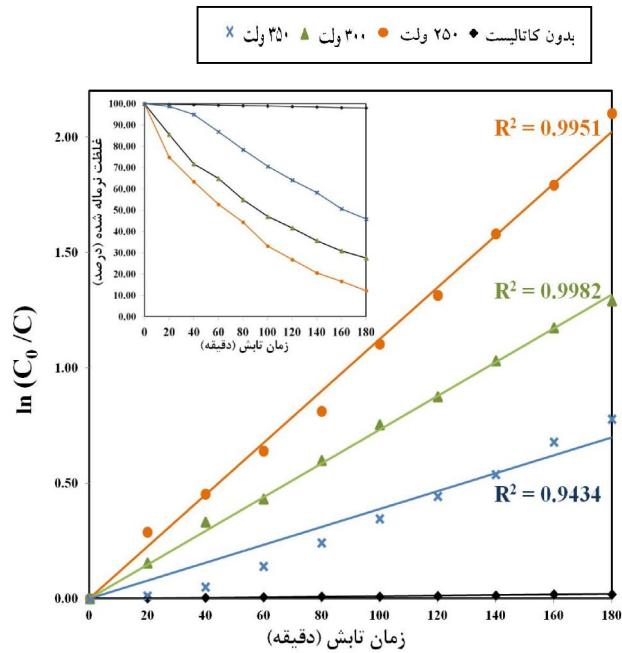
۳-۳- بررسی فعالیت فوتوكاتالیستی پوشش ها

برای بررسی خواص فوتوكاتالیستی لایه های رشد داده شده و هم چنین بررسی اثر ولتاژ اعمالی در قدرت فوتوكاتالیستی آن ها، لایه های ساخته شد مورد بررسی فوتوكاتالیستی قرار گرفت. ثابت سرعت واکنش تجزیه ماده مدل (۴-کلروفنل) بر روی سطح آن ها در حضور امواج فرابینفس، به عنوان معیاری برای مطالعه قدرت فوتوكاتالیستی آن ها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج آزمایش های فوتوكاتالیستی انجام شده بر روی لایه ها در شکل ۳ آورده شده است. این شکل تغییرات پارامتر $\text{In}(\text{C}_0/\text{C})$ و هم چنین تغییرات غلظت نرماله شده ماده ۴-کلروفنل را نسبت به زمان تابش امواج فرابینفس نشان می دهد.

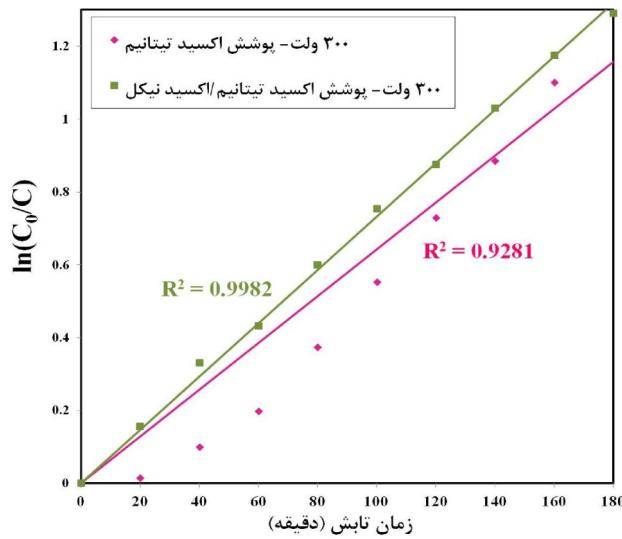
همان طور که از شکل ۳ مشخص است، در همه آزمایش های انجام شده با افزایش زمان تابش امواج فرابینفس، غلظت ۴-کلروفنل کاهش می یابد که نشان می دهد ۴-کلروفنل تجزیه شده است. سرعت کاهش غلظت ۴-کلروفنل در اثر تابش امواج فرابینفس در آزمایش های بدون حضور کاتالیست،

الکتروولیت حاوی فسفات سدیم با غلظت ۱۰ گرم در لیتر و ولتاژ ۳۰۰ ولت (ولتاژ میانی مرحله قبل) در مدت زمان ۵ دقیقه ساخته و میزان تخریب محلول ۴-کلروفنل روی سطح این لایه‌ها تحت تابش فرابنفش مشابه نمونه‌های قبلی اندازه گیری شد. شکل ۴، تغییرات غلظت نرماله شده ماده ۴-کلروفنل را نسبت به زمان تابش امواج فرابنفش برای نمونه‌ها نشان می‌دهد.

با در نظر گرفتن ثابت سرعت واکنش به عنوان معیاری از قدرت فوتوكاتالیستی لایه‌ها، مشاهده می‌شود که در ولتاژ ۳۰۰ ولت، لایه‌های ترکیبی NiO-TiO_2 توان فوتوكاتالیستی بالاتری از لایه اکسید تیتانیم خالص دارند. در واقع با وجود کاهش توان فوتوكاتالیستی لایه‌های NiO-TiO_2 در ولتاژ ۳۰۰ ولت (شکل ۳)، توان فوتوكاتالیستی آنها هنوز حدود ده درصد از لایه‌های TiO_2 خالص بالاتر است. احتمالاً یک مقدار بهینه برای اکسید نیکل برای حصول مازکریم فعالیت فوتوكاتالیستی اکسید تیتانیم وجود دارد که در این غلظت الکتروولیت استفاده شده (الکتروولیت حاوی ۵ گرم در لیتر اکسید نیکل) در ولتاژ ۲۵۰ ولت این مقدار بهینه از ذرات اکسید نیکل روی پوشش به دست آمده است. با افزایش بیشتر ولتاژ که منجر به افزایش میزان ذرات اکسید نیکل رسوب کرده در پوشش می‌شود، مقدار اکسید نیکل از این مقدار بهینه فراتر رفته که منجر به افت فعالیت فوتوكاتالیستی شده است. پژوهشگران دیگر نیز به نتایج مشابهی دست یافته‌اند [۳، ۱۶]. بنابراین با جفت کردن اکسید تیتانیم با اکسید نیکل، می‌توان در یک ولتاژ اعمالی پایین‌تر (۲۵۰ ولت) به توان فوتوكاتالیستی بالایی دست یافت که پیش از هر مزیت دیگری صرفه اقتصادی دارد. این در حالی است که نتایج کار سایر پژوهشگران نشان می‌دهد که اگر پوشش اکسید تیتانیم خالص باشد، برای حصول توان فوتوكاتالیستی قابل توجه لازم است که از ولتاژ‌های اعمالی بالایی استفاده کرد [۳۱]. این بهبود فعالیت فوتوكاتالیستی می‌تواند درنتیجه جفت کردن اکسید تیتانیم که یک نیمه‌هادی نوع n است، با نیمه هادی نوع p مثل NiO باشد که با ایجاد



شکل ۳- تغییرات $\ln(C_0/C)$ با زمان تابش امواج فرابنفش برای لایه‌های کامپوزیتی رشد داده شده در مدت زمان ۵ دقیقه، تحت ولتاژ‌های مختلف در الکتروولیت با غلظت ۱۰ گرم در لیتر فسفات سدیم و ۵ گرم در لیتر اکسید نیکل



شکل ۴- تغییرات $\ln(C_0/C)$ با زمان تابش امواج فرابنفش برای لایه‌های رشد داده شده در مدت زمان ۵ دقیقه، تحت ولتاژ ۳۰۰ ولت در الکتروولیت حاوی و فاقد اکسید نیکل

مستقیم طی یک مرحله و زمانی کوتاه ساخته شدند. نتایج نشان داد که:

- مقدار ذرات اکسیدنیکل رسوب کرده در پوشش با افزایش ولتاژ اعمالی افزایش می‌یابد.

- افروden اکسید نیکل به اکسید تیتانیم سبب افزایش توان فتوکاتالیستی آن می‌شود اما یک مقدار بهینه برای نیمه‌هادی اکسید نیکل برای بهبود خواص فتوکاتالیستی اکسیدتیتانیم وجود دارد که فعالیت فتوکاتالیستی در آن بیشینه است.

میدان الکتریکی داخلی در فصل مشترک این دو نیمه‌هادی، الکترون و حفرات ایجاد شده با نور از هم جدا می‌شوند. درنتیجه بازترکیب الکترون و حفرات ایجاد شده کاهش می‌یابد که منجر به افزایش فعالیت فتوکاتالیستی می‌شود.

۴- نتیجه‌گیری

پوشش‌های متخلخل کامپوزیتی اکسیدتیتانیم/اکسیدنیکل (TiO_2/NiO) با استفاده از روش ترکیبی اکسیداسیون پلاسمای الکتروولیتی/رسوب الکتروفورتیک (PEO/EPD) تحت جریان

واژه‌نامه

1. electrophoretic deposition

2. plasma electrolytic oxidation

منابع

1. Bhatkhande, D.S., Pangarkar, V.G. and Beenackers, A.A.C.M., "Photocatalytic Degradation for Environmental Applications- A Review", *Journal of Chemical Technology & Biotechnology*, Vol. 77, pp. 102-116, 2002.
2. Mital, G.S. and Manoj, T., "A Review of TiO_2 Nanoparticles", *chinese science bulletin*, Vol. 56, pp. 1639-1657, 2011.
3. Chen, C.J., Liao, C.H., Hsu, K.C., Wu, Y.T. and Wu, J.C.S., "P-N Junction Mechanism on Improved NiO/TiO_2 Photocatalyst", *Catalysis Communications*, Vol. 12, pp. 1307-1310, 2011.
4. Shifu, C., Yunguang, Y. and Wei, L., "Preparation, Characterization and Activity Evaluation of $TiN/F-TiO_2$ Photocatalyst", *Journal of Hazardous Materials*, Vol. 186, pp. 1560-1567, 2010.
5. Bayati, M.R., Molaei, R., Zargar, H.R. , Kajbafvala, A. and Zanganeh, S., "A Facile Method to Grow V-Doped TiO_2 Hydrophilic Layers with Nano-Sheet Morphology", *Materials Letters*, Vol. 64, pp. 2498-2501, 2010.
6. Farhangi, N., Chowdhury, R.R., Medina-Gonzalez, Y., Ray, M.B. and Charpentier, P.A., "Visible Light Active Fe Doped TiO_2 Nanowires Grown on Graphene Using Supercritical CO_2 ", *Applied Catalysis B: Environmental*, Vol. 110, pp. 25-32, 2011.
7. Khan, M., Xu, J., Chen, N. and Cao, W., "Electronic and Optical Properties of Pure and Mo Doped Anatase TiO_2 Using GGA and GGA+U Calculations", *Physica B: Condensed Matter*, Vol. 407, pp. 3610-3616, 2012.
8. Salami, N., Bayati, M.R., Golestani-Fard, F. and Zargar, H.R., "UV and Visible Photodecomposition of Organic Pollutants over Micro Arc Oxidized Ag-Activated TiO_2 Nanocrystalline Layers", *Materials Research Bulletin*, Vol. 47, pp. 1080-1088, 2012.
9. Yao, Z., Jia, F., Tian, S., Li, C., Jiang, Z. and Bai, X., "Microporous Ni-Doped TiO_2 Film Photocatalyst by Plasma Electrolytic Oxidation", *Applied Materials & Interfaces*, Vol. 2, pp. 2617-2622, 2010.
10. Lai, Y.K., Huangc, J.Y., Zhang, H.F., Subramaniam, V.P., Tangb, Y.X., Gongb, D.G., Sundarb, L., Suna, L., Chenb, Z. and Lina, C.J., "Nitrogen-Doped TiO_2 Nanotube Array films with Enhanced Photocatalytic Activity under Various Light Sources", *Journal of Hazardous Materials*, Vol. 184, pp. 855-863, 2010.
11. Liu, Y., Liu, J., Lin, Y., Zhang, Y. and Wei, Y., "Simple Fabrication and Photocatalytic Activity of S-Doped TiO_2 under Low Power LED Visible Light Irradiation", *Ceramics International*, Vol. 35, pp. 3061-3065, 2009.
12. Gao, P., Liu, J., Zhang, T., Sun, D.D. and Ng, W., "Hierarchical TiO_2/CdS Spindle-Like Composite with High Photodegradation and Antibacterial Capability under Visible Light Irradiation", *Journal of Hazardous Materials*, Vol. 229-230, pp. 209-216, 2012.
13. Mohamed, M.M., "Effect of Ceria-Doped Titania on the Structure and Acidic Properties of MoO_3/TiO_2 Catalysts", *Applied Catalysis A: General*, Vol. 267, pp. 135-142, 2004.
14. Liu, H., Shon, H.K., Sun, X., Vigneswaran, S. and

- Nan, H., "Preparation and Characterization of Visible Light Responsive Fe_2O_3 - TiO_2 Composites", *Applied Surface Science*, Vol. 257, pp. 5813-5819, 2011.
15. Ku, Y., Lin, C.N. and Hou, W.M., "Characterization of Coupled NiO/TiO_2 Photocatalyst for the Photocatalytic Reduction of Cr(VI) in Aqueous Solution", *Journal of Molecular Catalysis A: Chemical*, Vol. 349, pp. 20-27, 2011.
16. Shifu, C., Sujuan, Z., Wei, L. and Wei, Z., "Preparation and Activity Evaluation of P-N Junction Photocatalyst NiO/TiO_2 ", *Journal of Hazardous Materials*, Vol. 155, pp. 320-326, 2008.
17. Bayati, M.R., Gupta, P., Molaei, R., Narayan, R.J. and Narayan, J., "Phase Tuning, Thin Film Epitaxy, Interfacial Modeling, and Properties of YSZ-Buffered TiO_2 on Si(001) Substrate", *Crystal Growth & Design*, Vol. 12, pp. 4535-4544, 2013.
18. Hu, H., Xiao, W.J., Yuan, J., Shi, J.W., Chen, M.X. and Shang Guan, W.F., "Preparations of TiO_2 Film Coated on Foam Nickel Substrate by Sol-Gel Processes and its Photocatalytic Activity for Degradation of Acetaldehyde", *Journal of Environmental Sciences*, Vol. 19, pp. 80-85, 2007.
19. Lee, H., Park, S.H., Kim, S.J., Kim, B.H., Yoon, H.S., Kim, J.S. and Jung, S.C., "The Effect of Combined Processes for Advanced Oxidation of Organic Dye Using CVD TiO_2 Film Photocatalysts", *Progress in Organic Coatings*, Vol. 74, pp. 758-763, 2012.
20. Tavares, C.J., Marques, S.M., Rebouta, L., Lanceros-Mandez, S., Sencadas, V., Costa, C.M., Alves, E. and Fernandes, A.J., "PVD-Grown Photocatalytic TiO_2 Thin Films on PVDF Substrates for Sensors and Actuators Applications", *Thin Solid Films*, Vol. 517, pp. 1161-1166, 2008.
21. Grandcolasa, M. and Yeb, A.J., "N-doped Titania-Based Nanofiber Thin Films Synthesized via a Hydrothermal Route and Their Photo-Induced Properties under Visible Light", *Journal of Ceramic Processing Research*, Vol. 13, pp. 65-70, 2012.
22. Begum, N., Farveez Ahmed, H.M. and Gunashekhar, K.R., "Effects of Ni Doping on Photocatalytic Activity of TiO_2 Thin Films Prepared by Liquid Phase Deposition Technique", *Bulletin of Materials Science*, Vol. 31, pp. 747-751, 2008.
23. Xue, L., Kajiyoshi, K. and Yan, Y., "Preparation of Highly Oriented Titania Nanosheet Thin Films by Electrophoretic Deposition", *Thin Solid Films*, Vol. 518, pp. 10-15, 2009.
24. Schneider, O., Grobe-Brauckmann, J. and Argirakis, C., "Impedance Study of the Electrophoretic Deposition of Yttrium Silicate from a Polymeric Precursor Sol", *Journal of the European Ceramic Society*, Vol. 30, pp. 1089-1096, 2010.
25. Ciou, S.J., Fung, K.Z. and Chiang, K.W., "The Mathematical Expression for Kinetics of Electrophoretic Deposition and the Effects of Applied Voltage", *Journal of Power Sources*, Vol. 172, pp. 358-362, 2007.
26. Yerokhin, A.L., Nie, X., Leyland, A., Matthews, A. and Dowey, S.J., "Plasma Electrolysis for Surface Engineering (Review)", *Surface and Coating Technology*, Vol. 122, pp. 73-93, 1999.
27. Samanipour, F., Bayati, M.R., Golestani-Fard, F., Zargar, H.R., Mirhabibi, A.R., Shoaei-Rad, V. and Abbasi, S., "Innovative Fabrication of ZrO_2 -Hap- TiO_2 Nano/Micro-Structured Composites through MAO/EPD Combined Method", *Materials Letters*, Vol. 65, pp. 926-928, 2011.
28. Bayati, M.R., Golestani-Fard, F. and Moshfegh, A.Z., "The Effect of Growth Parameters on Photocatalytic Performance of the MAO-Synthesized TiO_2 Nano-Porous Layers", *Materials Chemistry and Physics*, Vol. 120, pp. 582-589, 2010.
29. Wan, L., Li, J.F., Feng, J.Y., Sun, W. and Mao, Z.Q., "Photocatalysts of Cr Doped TiO_2 Film Prepared by Micro Arc Oxidation", *Chinese Journal of Chemical Physics*, Vol. 21, pp. 487-492, 2008.
30. De, D. and Nicholson, P.S., "Role of Ionic Depletion in Deposition during Electrophoretic Deposition", *Journal of the American Ceramic Society*, Vol. 82, pp. 3031-3036, 1999.
31. Bayati, M.R., Golestani-Fard, F. and Moshfegh, A.Z., "How Photocatalytic Activity of the MAO-Grown TiO_2 Nano/Micro-Porous Films is Influenced by Growth Parameters?", *Applied Surface Science*, Vol. 256, pp. 4253-4259, 2010.